

2025年度JVIA表彰報告

2025年度JVIA表彰の各賞が決定しましたのでご報告いたします。表彰式は2026年5月29日に、日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋)第一会議室で行われました。

JVIA表彰は、当工業会の会員企業の中で、優秀で他の模範とすべきものを審査により選定し、真空産業に携わり、その発展に貢献していると認められる個人又はチームを表彰するものです。



表彰式参加のみなさん

賞名	社名	受賞者	受賞テーマ
真空装置大賞	アルバック・クライオ株式会社、株式会社アルバック	斎藤 政通、野末 竜弘 木村 豊、安田 瑠奈 藤原 裕也、西尾 樹	世界最高性能の希釈冷凍機
真空コンポーネント大賞	株式会社荏原製作所	田中 敬二、北川 敬太 岡田 岬、宮崎 一知 細谷 和正、郡山 日出人	一体型真空排気システムEVIS
真空装置部門賞	アルバック・ファイ株式会社	宮山 卓也、飯田 真一 戸津 美矢子、寺島 雅弘 橋本 真希	フルオート多機能走査型XPS/HAXPES装置 PHI GENESIS
技能・業務部門賞	株式会社昭和螺旋管製作所	石井 誠、玉井 宏明 矢吹 正	楕円形ベローズの開発
	アルバックテクノ株式会社、株式会社アルバック	鈴木 宗宜、竹井 智明 松木 祐海	国際規格を満たす真空計・ヘリウム校正リークの校正技術の確立

真空装置大賞

社 名：アルバック・クライオ株式会社、株式会社アルバック

受 賞 者：斎藤 政通、野末 竜弘、木村 豊、安田 瑠奈、藤原 裕也、西尾 樹

受賞テーマ：世界最高性能の希釈冷凍機

この度は、真空装置大賞という大変名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

本希釈冷凍機の開発は、量子コンピュータの実用化および大規模化に不可欠な、高出力かつ高安定な極低温環境の実現を目標として取り組んだものです。多数の超電導量子ビットの安定動作を支える冷却性能において世界最高性能を目指し、設計・解析・試作・評価を幾度となく重ねてまいりました。その過程では多くの技術的課題に直面しましたが、真空技術を基盤とした要素技術の融合により、従来の市販品を凌駕する性能を達成することができました。

本成果は、開発に携わった社内の多くの関係者、ならびに貴重なご助言をくださった共同研究者やお客様をはじめとする社外の皆様からのご支援の賜物です。心より感謝申し上げます。

今後も極低温・真空技術を通じて量子技術の発展に貢献し、科学技術と社会の進歩に寄与してまいります。



斎藤 政通氏、藤原 裕也氏、安田 瑠奈氏

真空コンポーネント大賞

社 名：株式会社荏原製作所

受 賞 者：田中 敬二、北川 敬太、岡田 岬、宮崎 一知、細谷 和正、郡山 日出人

受賞テーマ：一体型真空排気システム EVIS

この度は真空コンポーネント大賞という大変名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

近年、半導体の微細化・高集積化に伴うプロセスステップの増加やマルチチャンバー化により、付帯装置の設置数も増大し、サブファブエリアの過密化が深刻な課題となっています。

本システムは、高さを半減させたコンパクトな排ガス処理装置「LA+」の開発を機に誕生しました。創出した上部スペースに真空ポンプを設置し、両装置間を最短距離で結んでパッケージ化することで、お客様側での煩雑な設計検討を不要にしています。”真空”をコア技術として単一製品から真空ソリューションプロバイダーを目標とする当社にとって「省スペース」「省エネルギー」「省オペレーション」という3つの「省く」をコンセプトに、全てのお客様の共通課題解決への取り組みが評価されたことは、開発チームにとって大きな励みとなります。今回の受賞を糧に、今後も半導体製造の進化を支える革新的なソリューションの提供に邁進してまいります。最後に、本製品の製品化にご協力いただいた関係者の皆様にこの場を借りて心から感謝申し上げます。



田中 敬二氏、北川 敬太氏、岡田 岬氏

真空装置部門賞

社 名: アルバック・ファイ株式会社

受 賞 者: 宮山 卓也、飯田 真一、戸津 美矢子、寺島 雅弘、橋本 真希

受賞テーマ: フルオート多機能走査型XPS/HAXPES装置 PHI GENESIS

この度は、2025年度JVIA表彰におきまして、弊社の「フルオート多機能走査型XPS/HAXPES装置 PHI GENESIS」を真空装置部門賞にご選出いただき、誠にありがとうございます。選考委員ならびに日本真空工業会の皆様に厚く御礼申し上げます。

PHI GENESISは、XPS、HAXPESをはじめとする多彩な表面分析機能を統合し、測定の自動化と高い操作性により、研究開発から産業応用まで幅広い分析ニーズに応えることを目指して開発した装置です。本製品の実現にあたり、ご助言を賜りましたお客様、開発・製造・営業・サービスを支えていただいた関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みに、今後も真空技術および表面分析技術の発展に貢献し、お客様により高い価値を提供できる製品開発に努めてまいります。



宮山 卓也氏、飯田 真一氏、寺島 雅弘氏

技能・業務部門賞

社 名: 株式会社昭和螺旋管製作所

受 賞 者: 石井 誠、玉井 宏明、矢吹 正

受賞テーマ: 楕円形ベローズの開発

この度は、栄えある「JVIA 技能・業務部門賞」をいただき、身に余る光栄に存じます。

本テーマである「楕円形ベローズの開発」は、従来の円形とは異なる複雑な形状ゆえに、成形や耐久性の確保など、多くの技術的課題がありました。しかし、チーム一丸となって試行錯誤を重ね、独自の技術によって製品化を実現することができました。

審査にあたり、部門の枠にとらわれず、成果や独自性など多角的な観点から慎重に議論いただき、私たちの挑戦を評価していただけたことは、開発メンバー一同、大きな喜びであり最高の励みとなります。

この受賞を機に、社内外へ当社の高い技術力をさらにアピールし、今後もさらなる技術革新に挑戦してまいります。最後になりますが、開発にあたりご協力・ご支援をいただきました関係者の皆様に、心より厚く御礼申し上げます。



石井 誠氏、玉井 宏明氏

技能・業務部門賞

社 名: アルバックテクノ株式会社、株式会社アルバック

受 賞 者: 鈴木 宗宜、竹井 智明、松木 祐海

受賞テーマ: 国際規格を満たす真空計・ヘリウム校正リークの校正技術の確立

この度は、2025年度JVIA表彰／技能・業務部門賞という名誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。本開発により、国際規格ISO/IEC 17025に準拠した校正体制を基盤として、正確性および信頼性が保証された校正技術を確立することができました。その結果、真空ユーザの皆様が、国際的にも通用するILAC MRA付きJCSS認定シンボル入りの校正証明書を、より容易に入手できる環境を整えることができました。これにより、国内外の産業界や研究機関における真空計測の一貫性と透明性が向上し、国際的な技術標準との整合性の実現に貢献できたものと考えております。

本技術の確立にあたり、ご支援・ご協力を賜りました関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。今後もおお客様の製品品質向上と信頼性確保に貢献するとともに、長期的なパートナーシップの構築に努めてまいります。また、技術革新とサービス向上を通じて、業界全体の発展にも寄与してまいりたいと考えております。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



鈴木 宗宜氏、竹井 智明氏、松木 祐海氏